

PMD002/POL

偏光測定モジュール

空間偏光子回転方式の偏光・消光比測定モジュール。空間光測定にも対応。各種光ファイバやLDの他、VCSELのウエハレベル測定にも対応可能。

偏光測定モジュール PMD002/POL は、空間偏光子回転方式の偏光・消光比測定モジュールです。コリメートされた入射光の偏光状態を直接測定します。また、対物レンズを使用すれば、光ファイバや半導体レーザーの出射偏光状態を測定できます。

【特長】

- 高速かつ高い分解能・再現精度で偏光・消光比測定が可能。
- パルス回転ステージにより偏光子の回転を制御。高い角度精度。
- 対物レンズの装着が可能。光ファイバの他、各種レーザーやVCSEL等の空間光測定も可能
- 大口径ビームの測定が可能 (φ10mm コリメート光まで測定可能)

【製品の主な仕様・機能】

- 計測方式 空間偏光子回転方式
- 計測波長域 PMD002/POL VIS : 400~700nm
PMD002/POL NIR : 600~1100nm
PMD002/POL IR : 900~1700nm (開発中)
- 入射光量と消光比測定レンジ

入射光量	消光比測定レンジ
0.01~0.1(mW)	20(dB)
0.1~1(mW)	30(dB)
1~4(mW)	40(dB)

- 消光比測定再現性 ±0.5(dB)
- 消光比表示分解能 0.01(dB)
- 計測対象光束径 最大約 10mmφ(コリメート光)
- 計測角度範囲 360度
- 最小角度分解能 約 0.09°
- 角度測定分解能 ±0.5° (フィッティング使用時)
- 減光方式 フィルタポートへの減光フィルタ挿入方式 (センサーヘッド入射部に 1 枚挿入可能)

【標準構成品】

- 偏光測定モジュール PMD002/POL
 - センサーヘッド 1 式
 - コントロールユニット 1 式
 - 偏光測定ソフトウェア 1 ライセンス

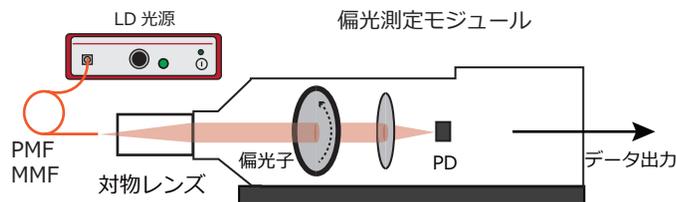
【オプション】

- 各種測定用架台
- 対物レンズ
- 減光フィルタ

【製品の主な応用】

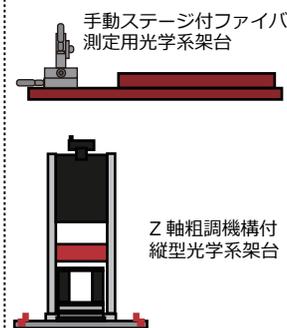
- 偏光・消光比の測定
 - ・各種レーザー
 - ・VCSEL
 - ・PMF、MMF 等各种光ファイバ

【測定例 マルチモード光ファイバの偏光・消光比測定】



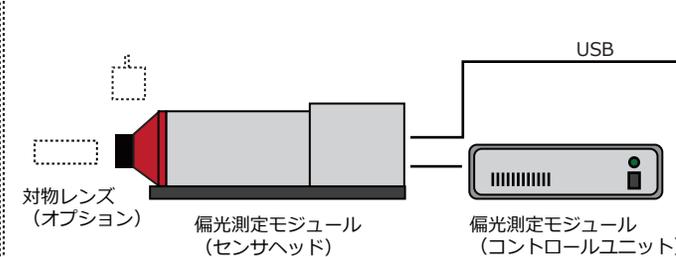
【偏光測定モジュール コンポーネントセレクション】

○位置決めステージ・架台



*ブローバへの搭載も可能です。

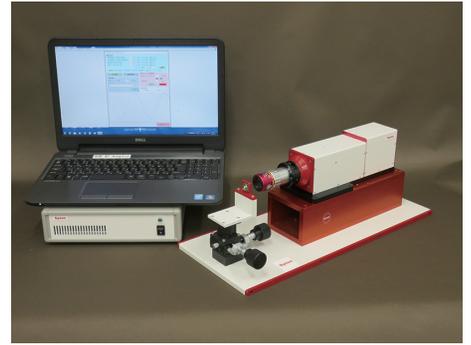
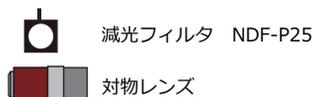
○偏光測定モジュール



○データ処理・解析装置

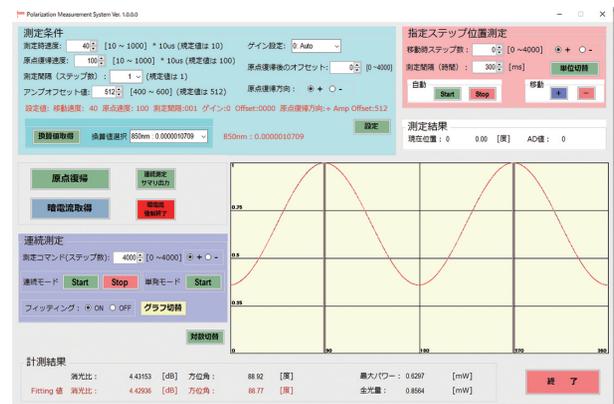


○アクセサリ

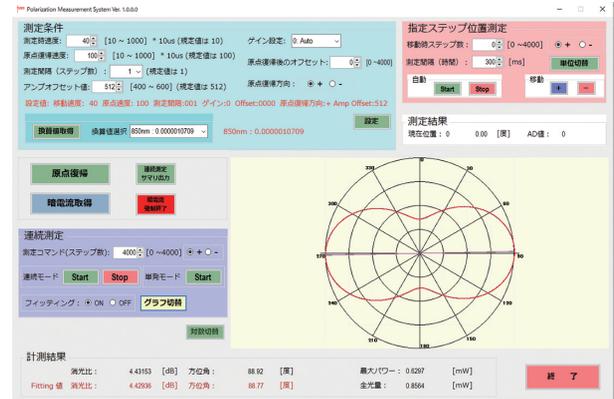


【偏光測定ソフトウェア Optometrics POL Basic】

- 測定パラメータ 消光比、方位角、全入射パワー、方位角方向のパワー
- 機能 グラフ表示機能、方位角消光比 vs パワー表示機能、フィッティング機能、計測条件設定機能
- データ保存 グラフデータ、グラフデータの csv 出力



○偏光グラフ表示



○方位角 vs パワー表示

